

開閉補助機構付き

研究・開発用 大型真空乾燥炉



- JIS500Aサイズ(内径約φ500)の大型真空槽(JIS300Aサイズでの対応も可)
- φ300のSiウエハを搭載できるヒータテーブルを内装
- 約70kgの上扉を片手で操作できる開閉補助機構(キャップバルancer)を搭載
- 到達真空度: 10Pa 以下/5分以内 (排気能力16l/minのスクロールポンプ接続時)
- 乾燥温度100℃~200℃の加熱ヒータを内装
- ヒータ電源: AC100V、1kW
- オプションで真空排気システムとの接続可
- ICF70ポート(3カ所)へ電流導入端子・リークバルブ等任意の真空部品を取付け可
- 真空乾燥炉の設置スペース: 約870(W)×640(D)×410(H) 総重量=約250Kg
- 参考価格帯(税別): オプションの真空排気システムを除く参考の価格帯です。
1式、¥4,000,000~¥5,000,000
- 通常納期は、ご注文後2.5~3か月